

簡稱	FE-SEM
中文名稱	超高解析熱電子型場發射掃描式電子顯微鏡
英文名稱	Ultra High Resolution Thermal Field Emission Scanning Electron Microscope
圖片	
功能說明	試片表面及截面幾何形狀觀測、凹凸面陰影觀測、元素鑑別及分析、觀測區域選定、調整景深及清晰度、數位螢幕顯示、材質含金屬、非金屬及無機物檢測。
儀器服務項目	樣品表面顯微影像、樣品成分半定量分析
儀器購置日期	2019/11/30
儀器廠牌	日本電子公司JEOL
型號	JSM-7610FPlus
儀器規格	二次電子影像偵測器
主要配件	能量發散光譜儀(EDS)、真空蒸鍍儀(鍍金、鍍碳)
樣品準備	固體、薄膜
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 樣品如須脫水乾燥或其他，請自行事先處理。2. 樣品直徑小於5mm且高度低於5mm，過大時，請洽技術員。3. 玻璃、矽晶片、ITO、FTO等，請事先自行裁切成上述大小。實驗室恕不允許現場裁切。4. 為避免對高真空造成污染，樣品不得為含高分子、水、油、高揮發性、磁性、粉末及多孔性材料等。且嚴禁生物類性質樣品。
儀器放置位置	工程三館 ES106